## 

# STM による単電子スピンの検出

## Detection of Single Electron Spin by Using Scanning Tunneling Microscope (STM)

## 米田忠弘

### Tadahiro Komeda

#### 東北大学多元物質科学研究所

- 要旨 走査型トンネル顕微鏡 (STM)を用いて単一スピンを検知する手法が次々と開発されているが、(1)近藤共鳴の観察によるスピン検知,特に有機分子の不対π軌道スピンによる近藤共鳴の検出,および(2)局在したスピンが磁場中で歳差運動を行うことを利用し、その周期に同期したトンネル電流の変化を測定しスピンを検知する手法、特にSi(111)-7×7表面におけるダングリングボンドをスピンセンターとするスピン信号検知について述べる。
- キーワード:走査トンネル顕微鏡,スピン,トンネル分光,ESR-STM,近藤効果

#### 1. はじめに

走査型トンネル顕微鏡 (STM) と透過型電子顕微鏡 (TEM) は異なった動作原理の顕微鏡であるが,ともに原子分解能を 持つ実空間顕微鏡であり,ナノサイズ物質評価には欠かせな い装置である.さらに共通点としては原子レベルの高分解能 観察に加えて,分析手法としての開発が進歩している.微小 領域分析手法として,像と同様の原子分解能に加えて,マク ロな領域での分光データと同じ精度の解析能力が期待される が,その実現は容易ではない.分析の内容にも変化が見られ, 最近では量子情報処理の要素技術としてスピンが注目されて いる.量子コンピューターの実現には,スピンの検知や評価 は欠くことのできない解析項目と考えられている<sup>1~6</sup>.電子 スピンの検知には電子スピン共鳴分光法 (ESR) が確立した 方法としてあるが,原子レベルの空間分解能を持った微小領 域のスピン分析への応用は難しい.

スピン検出が,STMのトンネル電流分光で行うことが可 能であれば、トンネル電流がほぼ原子1個の領域に集中する ことから、単電子スピン検出の空間分解能条件は満足される. しかしスピンが持つエネルギーは非常に小さく、例えばゼー マンエネルギー分裂は1Tの磁場で0.5 meV 程度である.こ れは4Kにおけるフェルミ準位の温度広がり程度のエネル ギーであり、その検出が困難なことが伺える.このような問 題を解決すべく,STM を用いたスピン検出手法の開発競争 が行われている.

本稿では、我々が行っている単電子スピン検出に関する最 近の研究を報告する.最初に近藤効果を用いてスピンを検出 する手法を示す.過去に行われた研究は磁性金属原子につい てのものが主であるが<sup>7~10</sup>、有機ラジカルから生じる近藤 効果について報告する<sup>11)</sup>.次に、局在したスピンが磁場中で 歳差運動を行うことを利用し、その周期に同期したトンネル 電流の変化を周波数分解することでスピンを検知する手法を 紹介する<sup>12,13)</sup>.周波数の計測からg値についての知見が得ら れ、ESR で行われているような化学種検知の可能性を持つ. これらは現在開発されているスピン検知手法のごく一部であ り、強磁場(10T程度)におかれた不対スピンのゼーマン 分裂を非弾性トンネル分光の手段によって検出する手法など 多くの注目される技術が競い合っている<sup>14,15)</sup>.

#### 2. 近藤状態の観測による単一スピン検出

近藤効果は孤立したスピンと伝導電子の相互作用によって 引き起こされる現象である.古くから銅や金といった非磁性 金属の中に希薄な磁性原子が存在するときに,ある温度以下 に冷却すると金属の抵抗が逆に上昇する現象が知られていた が,その機構は近藤によって孤立スピンと伝導電子のスピン の高次の摂動を考慮した理論で説明された<sup>7)</sup>.抵抗変化の反 転が起こる温度は近藤温度と呼ばれる.電流を担う伝導電子 にこの効果を応用すれば,実際のコンダクタンス変化を生じ させることが可能なため,スピントロニクスの要素技術とし て最近再び注目され多くの研究がなされている<sup>16~21)</sup>.

スピンに注目した場合,孤立スピンを遮蔽するように伝導 電子のスピン分極が生じ,フェルミ準位近傍の極狭いエネル ギー領域に高い状態密度を持った準位が形成されると考える ことが出来る.この状態は近藤状態と呼ばれるが,STMを 用いた観察では、トンネル電流分光によってフェルミ準位付 近に鋭い半値幅のピークとして観察することが可能であり, 単一スピンの情報を間接的に得ることが出来る.観察には近 藤温度以下での測定が求められ、また精密なトンネル電子の 分光には長い時間のデータの蓄積が必要になるために、ヘリ ウム温度以下でのSTM/STS(走査トンネル分光)測定が必 要となる.

最近では分子の持つスピンの研究に興味が高まっている. 分子は構造変化や官能基を修飾することによって電子状態や スピン状態を精密に制御することが可能であり,磁性金属原 子を用いた場合と比較して,異なるスピン制御機構が出現す る可能性がある.以下では,我々が行った有機分子の純粋な  $\pi$ 軌道に由来する近藤状態の観測について述べる.

## 2.1 2層フタロシアニン・テルビウム錯体における近藤 状態

試料分子は2層のフタロシアニン(Pc)を配位子とする テルビウム錯体であり、中心に金属原子が存在する.2層構 造のフタロシアニン分子では中心原子が3+の状態を取るこ

<sup>〒 980-8577</sup> 仙台市青葉区片平 2-1-1 E-mail: komeda@tagen.tohoku.ac.jp 2010 年 12 月 6 日受付

とが良く知られている(図1(a))。分子は中性であるため余 剰の3つの電子は2つある Pc 配位子に分配されると考える と、1つの Pc 配位子の  $\pi$  軌道に不対電子が存在する。その 結果、一つの分子に、テルビウム 4f 電子由来のJ=6スピンと、  $\pi$  軌道スピンが混在する状態を持つと考えられる。

TbPc<sub>2</sub> 分子は Pc 面を表面に平行にして吸着する.分子を 形成する原子のうち、中心の Tb と下層の Pc は、STM 探針 からの距離が大きいため、ほとんど STM 像に貢献しない. 例えば、上層と下層の Pc は STM 探針からの距離に 0.4 nm の差があり、これはトンネル電流が 10<sup>-4</sup> 程度に減衰する距 離であるため、下層 Pc が上層 Pc に比較して大きな基板と の軌道混成を生じるとしても STM 像には現れてこないと考 えられる.

上層の Pc の 4 つのフェニル環は,占有準位および非占有準 位の両方で,環の左右両端に高い状態密度を示す(図 1(b)). それにより 8 つの明るい点が観察される(図 1(c)).

この像を観察した後に,探針の水平位置を分子のある部分 に固定し,同時に垂直方向にも固定した状態で,試料電位 (V<sub>sample</sub>)を走査しながら微分コンダクタンス(dI/dV)を計測



図 1 (a) bis(phthalocyaninato)terbium (III) 分子 (TbPc<sub>2</sub>) の 構造モデル. (b) DFT 計算で予想される状態密度の分布. (c) 孤立 TbPc<sub>2</sub> 分子の STM 像(白線は1nm). (d) TbPc<sub>2</sub> フィルム像と分子位置の模式図. Iと II は STS の測定場所. (e) フェルミ準位付近での dI/dV 曲線の位置依存性.

する. dI/dV の大きさは  $V_{sample}$  おける状態密度に対応すると 考えられる. エネルギーはフェルミ準位を参照し,  $V_{sample} < 0$ の領域が占有準位の状態密度に対応する. 吸着分子に関する 測定では, 各分子軌道に対応するピークが観測されるが, 表 面吸着に伴う分子一基板の混成軌道形成のため通常 100 meV 程度の半値幅をもった幅の広いピークとして観察される. こ れに比較して近藤ピークはフェルミ準位付近に半値幅数 meV の幅の狭いピークとして現れることが特徴である.

実際の計測においては、電流 - 電圧曲線(I-V 曲線)を数 値微分するよりも、V<sub>sample</sub> に変調電圧を印加しロックインア ンプを用いた微分手法を用いることで、より精度良い計測が 可能である.しかしながら、この手法においてロックインア ンプ動作には長い時定数が必要になるので長時間フィード バック回路をオープンにする必要があり、4 K での測定が有 利である.図1(d)と(e)に位置に依存した dI/dV 曲線を示す. 探針を配位子の8つの輝点の上に置いた場合、鋭いフェルミ 準位付近のピーク(ZBP)が観察されるが、分子中心におい た場合には観察されない.これは最初の予想に反し、中心金 属ではなく配位子である Pc が近藤ピークを形成している可 能性を示している.

#### 2.2 近藤ピークの検証

ー般的に近藤状態を判断するには、温度変化と磁場依存性 がその検証材料となる. 図2(a)にZBPの温度依存性を示し ている. Nagaoka らは近藤ピーク幅と温度の関係( $\Gamma$ (T))に ついてフェルミ液体理論を用い<sup>22)</sup>、次のような関係を導出 している.  $\Gamma$ (T)=2 $\sqrt{(\pi k_B T)^2 + 2(k_B T_K)^2}$ : ここで $k_B$  ボルツ マン定数、 $T_K$ は近藤温度である.

我々の観察した温度変化(黒丸)をこの式を用いてフィットしたのが図2(b)であり,  $T_{\kappa}$ は~31Kと見積もられる.また近藤ピークの強度も温度とともに急激に減少することから近藤状態であることの有力な証拠となる<sup>23)</sup>:フェルミ準位近傍でのコンダクタンスの温度変化G(T)は次のように表される.

 $G(T) = G_0 \left( \frac{T_K^{'2}}{T^2 + T_K^{'2}} \right)^s, \ \text{ここで} G_0 \ \text{it} \ G \ \text{o} \ T = 0 \ \text{confin}, \ \text{str}$ s は経験的パラメター, str  $T_K^{'} = T_K / \sqrt{2^{1/s} - 1}$ と定義され  $G(T_K) = G_0/2 \ \text{o}$ 関係が成立する. 実際の温度変化は図 3 (c) に示したが経験的パラメター  $s = 0.2 \ \text{c}$ 用いて  $T_K = 31 \ \text{K} \ \text{c}$ う まく観測データをフィットすることが可能であった.

近藤ピークは磁場の印加によって2つのピークに分裂する ことが期待される.分裂幅は通常のゼーマン分裂幅の2倍と される<sup>24)</sup>.図3(d)に我々の系に磁場印加の影響を示す dI/dV の変化をB=0 and 8T の条件で比べたものである.B=8T の条件ではB=0Tに比較して半値幅 $\Gamma$ が~2meV 増加して いる.近藤温度が低い場合には磁場分裂は明瞭に観察される が<sup>25)</sup>,我々の場合でも $\Gamma$ ~6.5meV および 1.8meV の分裂 幅を持つ2つのピーク(これは8T でのゼーマン分裂の2倍 のエネルギー)を重ねたシミュレーション(図3(e))で実 験を再現することが分かる.

このようにして、ZBP が近藤ピークであることが示され

たと考えられる. 純粋な  $\pi$  軌道から生じる近藤効果は他に も議論されているが<sup>26</sup>,過去に構築された理論はほとんどが d あるいは f 電子から生じる近藤効果を説明するものであり, このような非局在化した  $\pi$  軌道に対する近藤効果は今後の 考察が必要と考える.

#### 3. ESR-STM 手法によるスピン検出

ここでは局在したスピンが磁場中で歳差運動を行うことを 利用し、トンネル電流の周波数分解で、ラーマー周期に同期 したトンネル電流の変化を測定することでスピンを検知する 手法について述べる<sup>12,13</sup>.まず、図3(a)のように孤立単一 スピンが磁場Bの中に置かれ、ラーマー歳差運動を行って いる状態において、その近傍にトンネル電子が注入され、短 時間だけ単一スピンと相互作用した後に、基板に散逸するモ デルを考える<sup>27,28)</sup>.その過程において局在スピンSと、ある 方向に偏極したトンネル電子のスピン σの相対的方向によ り交換相互作用に由来したトンネル障壁のエネルギー差が生 じる.そのエネルギーはJ(S・σ)であたえられる(図3(b)).



図2 (a) フェルミ準位付近での dI/dV 曲線の温度依存性. (b) 半値幅 vs 温度のプロット (実線はフィッティング結果. 本文参照). (c) ピーク高さ vs 温度のプロット (実線はフィッ ティング結果.本文参照). (d), (e) 4.7 K での磁場依存性, 測定結果 (d) とシミュレーション結果 (e).

ここでJはハイゼンベルグの交換エネルギーである. 局在ス ピンSと,トンネル電子のスピンσが平行か反平行にある条 件で,もっとも大きなトンネルの障壁の差が生じるが,それ は図3(c)に模式的に示してある. そのトンネル障壁の差に よってトンネル電流にも増減が生じて,その変化はラーマー 歳差運動の周期に一致すると考えられる(図3(d)). そのよ うなトンネル電流の変化があれば,スペクトルアナライザー を用いてフーリエ変換することでその変化の周波数が見積も られ,それよりg値についての知見が得られることになる.

これらの効果が実際の条件で、トンネル電流全体に及ぼす 影響を見積もることは重要である.1次元の矩形障壁をトン ネルする電流を考える場合,トンネル電流は exp ĸ 比例する. ここでゆはトンネル障壁のエネルギーと考えて よく, また $\phi_0 = \frac{\hbar^2}{8md^2}$ であり m は電子の質量, d はトンネル ギャップの距離である. トンネル障壁のエネルギーが局在 スピンSとトンネル電子のスピンσの関係により変化する からφ→φ-JSσと置き換えて考えればトンネル電流は – JSo で与えられる. Ιをスピンに関係の有る 無しで成分に分解し、 $I = I_0 + \Delta I$ とし  $\Delta I$ をスピン由来の成分 JSσ  $\Delta I \ l \ddagger \exp$ と表すことができる. トー 2ø  $タルの電流 I は I_a に \Delta I の大きさの正弦波が変調成分として$ 



図3 (a) ESR-STM 測定の模式図. (b) 孤立スピン (S) がラー マー歳差運動で伝導電子 σ とハイゼンベルグ交換相互作用 J で相互作用するモデル. (相互作用の大きさは J(Sσ) で表され る) それによるトンネル障壁の変化. (c) とトンネル電流変化. (d) の模式図. (e) ESR-STM 計測のためのセットアップ. ロッ クインアンプと交流変調磁場を印加する.

のっていることになる ( $\omega_L = \frac{g\mu_B B}{\hbar}$ で変化). 両者の比を見 積もることが可能で,  $\frac{\langle \Delta I^2 \rangle^{\frac{1}{2}}}{I_0} = \frac{2}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{\phi}{\phi_0}} \frac{JS\sigma}{2\phi}$ と表される. こ こでNは歳差運動の1周期にトンネルする電子の数である.  $\Delta I$ として $I_0$ の~2-4%程度の大きさが期待され, 十分に検 知しうる量である.

3.1 位相検知能力を備えた STM-ESR 信号検知システム 実験装置の構成を図3(e)に示す<sup>13)</sup>. ラーマー歳差運動と 同期したトンネル電流の高周波での変調を検出するのが主要 な目的である. トンネル電流はフィルターをもちいて低周波 成分と高周波成分に分配される.低周波成分は通常のSTM 観測に用いられる制御回路に入力され、探針の位置制御を行 う. 高周波成分はスピン由来の交流成分の検出に用いる. 高 周波成分は高周波増幅器で増幅された後、スペクトルアナラ イザーに入力され間波数分析を行うが、周波数の検出限界に 上限があるため~1GHz以下の周波数検出が適している. この周波数帯は、様々な用途で利用されているため、それら のノイズを低減する工夫が必要である. ここではロックイン アンプを用いた手法を用いている. 固定磁場に加えて1KHz 程度の周波数をもつ交流磁場を印加する.印加した交流成分 に一致する周波数の信号が磁場に由来する信号であることか ら、その変調周波数に同期する信号をロックインアンプで検 知することで信号の確度が上昇する. ロックインアンプから 発生される正弦波を参照信号および変調磁場作成のために用 いる. コイルにより作成された変調磁場は試料近辺に設置さ れた永久磁石がつくる静磁場に重畳される. スペクトラムア ナライザーの出力はビデオ信号としてとりだされ、ロックイ ンアンプに入力される.

#### 3.2 シリコン酸化膜でのスピン検出

Si(111)-7×7極初期の酸化表面に対して行った実験につい て説明する.通常のESRをもちいた極初期の酸化シリコン 表面でのスピン検出はすでに報告されている<sup>29)</sup>.基本的には 表面上のダングリングボンドがESRシグナルの起源となり  $P_{s0}$ と名づけられている.酸化によってこれらダングリング ボンドは減少すると考えられ、Si(111)-7×7構造において最 もその強度が強くなると予想されるが、実際のESR実験で は、極初期の酸化すなわち数L(1L=10<sup>-6</sup> Torr sec)の酸素 露出によって、最大のESR 信号が検出されている.

その理由として清浄面 Si(111)-7×7 表面での金属的な電子 状態が挙げられる.金属的な挙動をしめすためスピン緩和時 間が非常に短く、ピーク幅は大変広いものとなり、清浄表面 で ESR 信号が非常に弱い原因となっている.清浄表面から 極わずかな酸素露出で増加しているように見えるのは、この 電子状態が局在化し緩和時間が長くなったことによるものと 思われる.我々の実験においても、 $P_{s0}$ で表せる信号を取る ために清浄表面を~3Lの酸素を露出することにより極薄い 酸化膜を得たものに対して実験を行った.

Si(111)-7×7表面に~0.5L程度の酸素露出(1L=1×10<sup>-6</sup>

torr sec)を行ったとき、明るい点と暗い点の両方が STM 像 に出現することが知られている.STM 像で得られる違いは、 理論計算や他の光電子分光や振動分光と組み合わせて議論さ れ、明るい点はアドアトムとバックボンドの間に酸素原子が 入り込んだ構造(図4(a))、暗い点はアドアトム直上に酸素 原子が存在する構造(図4(b))と理解されている<sup>30,31)</sup>.前 者の酸素原子が存在しても、対応するアドアトムの直上に酸 素原子が吸着するときはやはり暗い点として観察される.こ の電子状態の違いの原因として前者の場合にフェルミ準位付 近に状態密度が増加することが考えられる.後者については アドアトムのダングリングボンドが酸素との結合でなくなる ためフェルミレベル付近の準位の状態密度が減少し暗く観察 されると考えられる.実際に観察された非占有準位について のSTM 像を図4(c)に示す.A、B がそれぞれ明るいアドア トム、暗いアドアトムに相当する.

この表面においてスピン信号の検出を行った. スピン信号



図4 (a) (b) シリコン(111)-7×7表面への酸素吸着で出現す る(a) 明るいアドアトム,(b) 暗いアドアトムの原子模型.(c) 両アドアトムのSTM 像.(e)-(g) ドリフト補正装置により繰 り返し測定で得られたスピン信号.同一箇所での測定でスピン 信号が再現性良く取得されている.(h) スピン信号の周波数 vs 出現頻度のヒストグラム.明るいアドアトム,暗いアドア トム,明るいアドアトムに隣接する原子についての結果を示す. 計測場所の表面状態と,信号の相関を取ることが重要であり, そのためには分光を行った場所を正確に特定する必要がある. 測定に用いた手法を図4を用いて説明すると次のようになる.

まず図4(d)の右上から像の走査を開始し、表面トポグラ フ像を記録する.あらかじめ指定した点まで走査が進んだと き、走査をいったん中止し、約4分間スピンスペクトロスコ ピーの計測と記録を行う.図では丸印に相当する.その測定 の終了後、再び像走査が再開され記録される.図4(e)に丸 印で得られた明るいアドアトムに関するスペクトルを示す. 403 MHz付近にピークが観察され,B~143Gに対してg~2.0 のラーマー周波数と一致する.図4(f)はドリフト修正プロ グラムが働いた後に再び、像観察+スペクトル測定を行っ たものである.図4(d)と比較してドリフトによる像の移動 が無視できることが分かる.加えて得られたスペクトル (図4(g))も、同じ周波数に再現性よく現れている.

図4(h) にヒストグラムを示す. このヒストグラムは(1) 明るいアドアトム,(2) 暗いアドアトムおよび(3) 明るい アドアトムの隣のアドアトムの3つのサイトで~150のサン プルについて調べたもので周波数と出現頻度を示している. (1)においては403 MHzを中心として2 MHzの広がりを持っ た分布が見られるが,(2) においては実験誤差以下の頻度で しか出現しなかった.また(3) においてもスピン由来のピー クが観察されるが,(1) の場合からシフトした周波数におい て検出されている.この周波数はg~2.01 程度に相当する と考えられる.

まず(1)において観察されるピークは上述の P<sub>s0</sub>成分で あると考えられる. このアドアトムは酸素分子が表面で解離 しバックボンドに両方が入った図4(a)の状態にあると考え られる. Si(111)-7×7の金属性はダングリングボンド由来の 電子状態が遍歴性をもち、バンド構造をつくることによると 考えられる.しかしながらダングリングボンドの間の距離は 7Åよりも大きく、ダングリングボンドのバンドは下層の Si アトムを介したものであると考えられ、バンドのエネルギー 幅も小さいものとなっている. このような構造において酸素 原子がバックボンドに挿入された場合 Si(111)-7×7 表面の金 属的な性質が弱められることは容易に想像される. アドアト ム自身のダングリングボンドは直接に影響を受けず、緩和時 間が長くなったため P<sub>st</sub> シグナルが ESR 信号として検知でき るようになったと考えられる. 明るいアドアトム周辺におい てもスピン信号が検出される. これはそのアドアトムのバッ クボンドには酸素が挿入されていなくとも、隣接するアドア トムバックボンドに存在する酸素原子のために、ダングリン グボンドバンドの周期性が乱されたため、金属的な振る舞い が抑えられ、信号が出現したものと考える. 対照的にアドア トム直上に吸着した場合(図4(b))はダングリングボンド が消滅するのでシリコンのスピンそのものが観察されないこ ととなる. これは図4のヒストグラムで観察された暗いア ドアトムでスピンが検出されないことをうまく説明する.

#### 4. 今後の展望

有機 π 軌道によって生じる近藤効果に関する研究は、磁 性金属原子を扱った研究と比較して報告数が極端に少なく、 その物理現象そのものが興味の対象である.また分光手法と しても近藤ピークに付随するサイドバンドなどから、振動や スピンフリップなどの高分解能の情報も得られることが期待 され、今後それらを用いた精密な計測手法として発展すると 考える.トンネル電流と高周波との組み合わせによる ESR-STM はスピンの存在に加えて、スピンの方向を検知する 手法、核スピンの検出手法などに開発が進んでいくと考えら れる.

#### 文 献

- Mozyrsky, D., Fedichkin, L., Gurvitz, S.A. and Berman, G.P.: *Phys. Rev. B*, 66, 161313 (2002)
- 2) Levitov, L.S. and Rashba, E.I.: Phys. Rev. B, 67 (2003)
- 3) Bulaevskii, L.N. and Ortiz, G.: Phys. Rev. Lett., 90, 040401 (2003)
- Bulaevskii, L.N., Hruska, M. and Ortiz, G.: *Phys. Rev. B*, 68, 125415 (2003)
- Galperin, Y.M., Kozub, V.I. and Vinokur, V.M.: Phys. Rev. B, 70, 033405–033404 (2004)
- 6) Hastings, M.B.: Phys. Rev. B, 70, 161301-161304 (2004)
- 7) Kondo, J.: Phys. Rev., 169, 437 (1968)
- Li, J.T., Schneider, W.D., Berndt, R. and Delley, B.: *Phys. Rev. Lett.*, 80, 2893–2896 (1998)
- Madhavan, V., Chen, W., Jamneala, T., Crommie, M.F. and Wingreen, N.S.: *Science*, 280, 567–569 (1998)
- Zhao, A.D., Li, Q.X., Chen, L., Xiang, H.J., Wang, W.H., Pan, S., Wang, B., Xiao, X.D., Yang, J.L., Hou, J.G. and Zhu, Q.S.: *Science*, 309, 1542–1544 (2005)
- Komeda, T., Isshiki, H., Liu, J., Zhang, Y.-F., Lorente, N., Katoh, K., Breedlove, B.K. and Yamashita, M.: *Nat. Commun.*, 2, 217 (2011)
- 12) Sainoo, Y., Isshiki, H., Shahed, S.M.F., Takaoka, T. and Komeda, T.: *Appl. Phys. Lett.*, 95, 082504 (2009)
- 13) Komeda, T. and Manassen, Y.: Appl. Phys. Lett., 92, 212506 (2008)
- 14) Heinrich, A.J., Gupta, J.A., Lutz, C.P. and Eigler, D.M.: Science, 306, 466–469 (2004)
- 15) Tsukahara, N., Noto, K.I., Ohara, M., Shiraki, S., Takagi, N., Takata, Y., Miyawaki, J., Taguchi, M., Chainani, A., Shin, S. and Kawai, M.: *Phys. Rev. Lett.*, **102**, 167203 (2009)
- 16) Knorr, N., Schneider, M.A., Diekhöner, L., Wahl, P. and Kern, K.: *Phys. Rev. Lett.*, 88, 096804 (2002)
- 17) Neel, N., Kroger, J., Limot, L., Palotas, K., Hofer, W.A. and Berndt, R.: *Phys. Rev. Lett.*, 98, 016801 (2007)
- 18) Iancu, V, Deshpande, A. and Hla, S.-W.: Phys. Rev. Lett., 97, 266603 (2006)
- Rossi, E. and Morr, D.K.: Phys. Rev. Lett., 97, 236602–236604 (2006)
- 20) Lazarovits, B., Simon, P., Zarand, G. and Szunyogh, L.: *Phys. Rev. Lett.*, 95, 077202–077204 (2005)
- 21) Wahl, P., Diekhoner, L., Schneider, M.A., Vitali, L., Wittich, G. and Kern, K.: *Phys. Rev. Lett.*, 93, 176603–176604 (2004)
- 22) Nagaoka, K., Jamneala, T., Grobis, M. and Crommie, M.F.: *Phys. Rev. Lett.*, 88, 077205 (2002)

- 23) Goldhaber-Gordon, D., Göres, J., Kastner, M.A., Shtrikman, H., Mahalu, D. and Meirav, U.: *Phys. Rev. Lett.*, **81**, 5225–5228 (1998)
- 24) Meir, Y., Wingreen, N.S. and Lee, P.A.: Phys. Rev. Lett., 70, 2601– 2604 (1993)
- 25) Park, J., Pasupathy, A.N., Goldsmith, J.I., Chang, C., Yaish, Y., Petta, J.R., Rinkoski, M., Sethna, J.P., Abruna, H.D., McEuen, P.L. and Ralph, D.C.: *Nature*, 417, 722–725 (2002)
- 26) Fernandez-Torrente, I., Franke, K.J. and Pascual, J.I.: *Phys. Rev. Lett.*, 101, 217203 (2008)
- 27) Balatsky, A.V., Manassen, Y. and Salem, R.: *Phys. Rev. B*, 66, 195416–195420 (2002)
- 28) Zhu, J.-X. and Balatsky, A.V.: Phys. Rev. Lett., 89, 286802 (2002)
- 29) Umeda, T., Nishizawa, M., Yasuda, T., Isoya, J., Yamasaki, S. and Tanaka, K.: *Phys. Rev. Lett.*, 86, 1054–1057 (2001)
- 30) Lyo, I.W., Avouris, P., Schubert, B. and Hoffmann, R.: J. Phys. Chem., 94, 4400–4403 (1990)
- 31) Avouris, P. and Lyo, I.W.: Surf. Sci., 242, 1–11 (1991)